





<u>Doc.No: NR010514</u> 2001年5月14日

## 米国大手半導体メーカーから 300ミリウエハ対応洗浄装置を一括受注

大日本スクリーン製造株式会社(本社:京都市上京区/社長:石田 明)は、300ミリプロジェクトを推進している米国大手半導体メーカーから、最新の300ミリウエハ対応の洗浄装置「Wet Station FC-3000」を一括受注、納入を2001年末から開始します。

FC-3000は、薬液循環と薬液置換の両洗浄技術を融合させ、幅広い用途とハイクリーン洗浄を両立させた300ミリウエハ対応のワンバス式ウェットステーション。ランニングコストの低減に向けて、装置サイズの大幅な縮小も図りました。 当社独自のソフトウエアを採用し、高精度な制御で迅速かつ正確に大サイズウエハを搬送します。バスは目的用途に応じて最大6槽まで搭載可能で、スループットの向上を図れます。

FC-3000は、1999年度上期から出荷を開始し、2001年4月には50台の出荷実績を達成しました。出荷先は日本、台湾、米国で、今回の受注は米国では3社目となります。半導体工場の設備投資が世界各地でスローダウンしている中で、300ミリウエハ装置の投資は予定どおりに進んでおり、この3月下旬から稼働している300ミリウエハ洗浄装置専用工場「Fab. FC-1(ファブ・エフシーワン)」で受注に対応しています。2001年度のFC-3000の出荷予定台数は100台です。



FC-3000の生産工場 「Fab. FC-1(ファブ・エフシーワン )」



300ミリウエハ対応のワンバス式洗浄装置 「FC-3000」